

## 大型真空蒸着装置 ED-3100



高真空蒸着装置ED-3100はマスフローコントロール式ガス導入系をもっているため、反応性蒸着が可能です。光学式と水晶式の2種類の膜厚モニターによって、各種の膜厚制御が可能です。

### 大型真空蒸着装置ED-3100仕様

- 到達圧力      ×10<sup>-5</sup>Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径      φ700mm×700mmH SUS304 電解研磨
- 蒸着機構      電子銃最大投入電力:10KW  
ルツボ容量:10ml×2/40ml×2  
ルツボ個数:4個
- 基板回転      基板形状:250mm×250mm  
磁気シール駆動方式 0~30rpm
- 基板加熱      マイクロシースヒーター  
常温~300℃迄昇温可能  
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計      光学式膜厚計・水晶振動式膜厚計
- 真空排気系      油回転ポンプ:1300L/min[60Hz]  
メカニカルブースターポンプ:300m<sup>3</sup>/h[60Hz]  
油拡散ポンプ:5400L/sec
- 真空計      大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法      排気系全自動(手動操作も可)
- ユーティリティ電気:AC200V三相20KVA  
冷却水:20L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25℃以下循環  
計装エア:0.5MPa以上  
設置寸法:1800mmW×2400mmD×1900mmH